

## Mitutoyo Plan-APO-Objektiv für WLI, 10X

Mehr Produkte von [Mitutoyo](#)



10X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective

Produkt #74-657 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €9.690<sup>00</sup>

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€9.690,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

378-401 **Modellnummer:**

**Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):**  
Focal Length: 100mm

Infinity Corrected **Art:**

Mitutoyo **Hersteller:**

**Hinweis:**  
Designed to be used with a 100mm Tube Lens, Sold Separately

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

54.00

Max. Durchmesser (mm):

40.00

Gewicht (g):

220.00

## Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:

0.88mm

Brennweite BW (mm):

10.00

Vergrößerung:

10X

Numerische Apertur NA:

0.38

Auflösung (µm):

0.72

Tiefenschärfe (µm):

1.90

Arbeitsabstand (mm):

6.00

Feldzahl:

11.00

Parfokallänge (mm):

60.00

## Sensor

Max. Sensorgröße:

2/3"

## Gewinde & Montage

Gewinde:

RMS/20.32mm x36 TPI

## Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

## Produktdetails

- Ideal für Interferometrie-Anwendungen
- Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
- Hochqualitatives plan-apochromatisches Design

Die unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive für WLI von Mitutoyo sind hochauflösende plan-apochromatische Objektive mit hohen numerischen Aperturen für den Einsatz in Weißlichtinterferometrie-Anwendungen. Die Objektive sind kompakt und leicht und erreichen dennoch lange parfokale Arbeitsabstände von 60 mm. Jedes Objektiv beinhaltet einen Interferenzring-Einstellmechanismus und einen internen Strahlteiler für die präzise Vermessung und Steuerung des Interferenzringmusters. Die unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive für WLI von Mitutoyo werden mit Vergrößerungen zwischen 2,5X und 50X angeboten und wurden für Tubuslinsen mit 100 mm Brennweite entwickelt. Die Objektive sind ideal für Weißlichtinterferometrie-Anwendungen wie Vertical Scanning Interferometry (VSI), 3D-Oberflächenprofilierung, Dispersions- und Reflexionsmessung und medizinische Bildgebung.